

Advansic 高性能静電チャック

Electrostatic Chuck

特徴

- ・広温度域に対応出来ます。 (室温～200℃)
- ・吸着・離脱特性に優れています。 (2秒以内)
- ・表面状態が優れています。 ($Ra < 0.01 \mu m$)
- ・冷却特性に優れています。 (30w/mK)
- ・吸着表面の金属汚染及びパーティクル量が低減できます。
($< 10^{10} \text{ atoms} \cdot \text{cm}^{-2}$) ($\uparrow 0.21 \mu m < 500/8\text{inch-wafer}$)
- ・フロン系、酸素系プラズマの耐性に優れています。
- ・長寿命



Items		
純度 (除く Al Si)		4N
シリコンウェハへの汚染	$\text{atoms}/\text{cm}^{-2}$	$< 10^{10}$
シリコンウェハ上のパーティクル数	Counts/8inch	< 500
吸着力(ドット無)	gf/cm^2	> 2500
吸脱着時間	sec	< 2
バックガスシール性能 (5kPa)	sccm	< 0.5
熱伝導度	at R.T.	30
	at 200℃	22
静電チャックの表面平面度	μm	2
表面粗さ	μm	0.01